

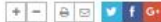
## PMT orders maskless lithography system from EV Group - January 25, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. The LITHOSCALE system will be installed at PMT's headquarters in Asan-si, Chungcheongnam-Do, South Korea, where it will be used in the production of next-generation MEMS-based probe cards for wafer-level testing of advanced NAND, DRAM and HBM devices. According to Young-Sik Yun, general manager of EV Group Korea, "Wafer-level testing with probe cards is an essential process for improving device production yields and reducing overall test cost per die. LITHOSCALE offers a unique combination of high resolution, high flexibility to handle many different product designs, and low cost of ownership, making it an ideal solution for manufacturing fine-pitch wafer probe cards. We are pleased to support PMT in their efforts to expand their product portfolio and shorten their development cycles."

HOME > 업계뉴스

### 피엠티, EV 그룹의 마스크리스 리소그래피 시스템 발주

2024년 01월 25일



EV 그룹(EV Group, EVG)은 세계적인 반도체 웨이퍼 프로브 카드 선도 기업인 한국의 피엠티(PROTEC MEMS Technology)로부터 자사의 LITHOSCALE 마스크리스 노광 시스템에 대한 공급 계약을 수주했다고 밝혔다. 이번 계약으로, EVG의 LITHOSCALE 시스템은 피엠티 분사(출납)인산시 소재에 설치되어 첨단 NAND, DRAM, 고대역폭 메모리(HBM) 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트를 위해서다 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

피엠티의 조영호 대표이사는 "미세 피치 프로브 카드는 반복적인 리소그래피 패러미터 공정을 통해 제작되어 제조 비용 증가 최소화가 필요하다"며, "자사의 마스크 얼라이너(Mask Aligner)를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리스(Maskless) 노광 장비인 LITHOSCALE로 대체함으로써, 제조 비용의 절감이 가능하고, 공정 개발 속도 또한 혁신적으로 단축 가능할 뿐 아니라 프로세스 상용도 더욱 향상할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 우리는 첨단 프로브 카드 제조 및 개발에 있어 EVG의 LITHOSCALE를 아니라 다양한 프로세스 솔루션을 통한 협력을 이어갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

EVG의 MLE(Maskless Exposure) 기술을 적용한 LITHOSCALE은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성을 필요로 하는 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다. LITHOSCALE은 실시간 레이어 전송과 즉각적인 노광을 가능하게 하는 강력한 디지털 프로세스 능력과 높은 구조적 분해능 및 생산 신뢰성 확립을 결합함으로써, 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다. EVG의 LITHOSCALE은 산소산 프로브 카드 개발에 매우 이상적인 솔루션으로서, 턴어라운드 시간과 연구개발 주기를 단축할 수 있게 해준다.

MEMS 제조는 특히 미세공정의 복잡성으로 인해 공정 난이도가 높으며, 그 결과 마스크 제조비용 증가를 피할 수 없는 한계가 있다. 마스크를 사용하지 않는 LITHOSCALE은 높은 초점 심도와 고분해능(2m 수준의 US/Line & Space)의 성능을 보장함에 따라, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고밀도 게이트 레이어(RDL)와 비어(Via) 연결이 가능하게 해준다.

EVG 한국지사의 운영식 이사장은 "피엠티가 자사 제품 프로덕티비를 향상하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 돕게 되어 매우 기쁘다"고 밝히고 "프로브 카드에 사용되는 웨이퍼 레벨 테스트는 디바이스 생산 수율을 높이고 다양한 전이점인 테스트 비용을 낮추기 위해서 필수적인 공정이다. LITHOSCALE은 높은 분해능, 다양한 애플리케이션을 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소류 비용 특성을 결합한 혁신적인 솔루션으로서, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 매우 이상적"이라고 밝혔다.

[https://all4chip.com/archive/news\\_view.php?no=17188](https://all4chip.com/archive/news_view.php?no=17188)